

(○) Simultaneous adsorption method

(●) Adsorption method

これは Hr の生成機構においてシラノール基が関与する

この生成機構は、シラノール基の数がより多い

この生成機構は、シラノール基の数がより多い

Fig. 1. Percent grafting at 16 Mpa pressure

〔2〕 同時照射法の考え

.....(2)

.....(3)

.....(4)

.....(5)

.....(6)

(7)

(8)

(9)

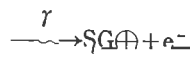
.....(10)

.....(11)

$S_1, S_2, \dots, S_n = 0, 0, \dots$

4)

SG



5)  $G_i$  の生成

(Hi)

$S_1, S_2, \dots, S_n = 0, 0, \dots$

(90.01)